

2021年夏の電子顕微鏡解析技術フォーラムのお知らせ

公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
責任者 丸山 秀夫
実行委員長 遠藤 徳明

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な疑問点をざっくばらんに話し合う場として〈電子顕微鏡解析技術フォーラム〉を開催しております。

今年度は昨年度と同様、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、オンラインで開催します。

今回のテーマは「全ての結果は試料作製が握っている！TEM 試料作製方法の古典から最新まで！」と題し、電子顕微鏡観察で材料や現象の真の姿を捉えるために最も重要な技術となる試料作製法を取り上げます。

代表的な電子顕微鏡観察試料作製法として、FIB法(Ga, Xe-Plasma)、Arイオンミリング法、電解研磨法を取り上げ、各分野のエキスパートの方々より、基本原理から実際の適用事例、ダメージやアーティファクト等の問題点と対策等についてご講演頂きます。

講演内容に関して、参加者の皆様からの質問をいただきながら、活発な議論を交わして、日頃の電顕業務の問題解決の糸口が得られる場となれば幸いです。

電子顕微鏡に携わる皆様、ふるってご参加ください！

記

1. 主 催：公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会

2. 日 時：2021年8月24日（火）13:00～17:00（予定）

開催形式：オンライン開催（web会議システム Teams）

参加費：無料

3. 定 員：150名

4. 申し込み期間：8月5日～8月17日（定員になり次第締め切ります）。

申し込み方法：8月5日に電子顕微鏡解析技術フォーラム HP 上にてお申込みフォームの URL を公開いたします。サイトにアクセスして頂き、必要事項をご記入の上、お申込みください。

問い合わせ先：

日鉄テクノロジー（株） 水尾 有里 e-mail: mizuo.yuri.8dg@nstec.nipponsteel.com

電 話：0439-80-2866 ファクシミリ：0439-80-2733

HP：<http://www.em-forum.sakura.ne.jp/>

5. プログラム

【チュートリアル】

- ・FIBの基礎 ー観察から薄膜作製までー

渡邊 慶太郎(日立ハイテク)

【トピックス】

- ・プラズマイオン FIB による高品質 TEM 試料作製

村田 薫(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

- ・Ar イオンを用いた BIB 法と TEM/SEM 試料作製

佐々木 義和(日本電子)

- ・電子顕微鏡観察試料作製のための電解研磨法 ～基礎から実践まで～

宮澤 知孝(東京工業大学)

〈電子顕微鏡解析技術フォーラム実行委員〉

丸山 秀夫(カネテック)、石丸 雅大(サーモフィッシャーサイエンティフィック)、乾 光隆(セイコーエプソン)、遠藤 徳明(日本電子)、木村 耕輔(東レサーチセンター)、工藤 修一(材科学)、志摩 会実佳(東芝ナノテクノロジ)、白井 学(日立ハイテク)、高橋 知里(産総研)、長澤 忠広(ライマックス)、水尾 有里(日鉄テクノロジー)、宮澤 知孝(東京工業大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、村上 和歌子(リコー)、吉田 誠(旭化成)、和田 充弘(三井金属)